

リアルタイム微小表面変位測定装置

1 mm の 1/1,000,000
ナノメートルを測る。

概要

本装置は、青紫色レーザと CCD カメラおよび新技術を用いた、物体表面の高さ計測をリアルタイムかつナノメートルオーダーでおこなう変位測定装置です。

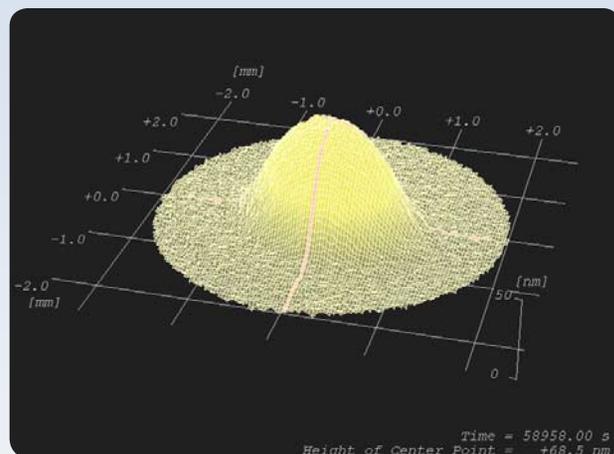
測定対象となるすべての画素の高さデータを、並列に高速・高精度に計測するので、時間とともに部分的に微小変化する物質の表面高さの測定に適し、その他微小な凹凸の高さ測定、表面粗さ測定などに応用することができます。

特長

- ▼ 物体表面の微小な凹凸をリアルタイムに測定
- ▼ 表面形状の経時変化の測定に最適（相対モード）
- ▼ 絶対量測定も可能（直接モード）
- ▼ 相対モードで ± 1nm、直接モードで ± 15nm の測定精度
- ▼ 直径 10mm の視野をサイクルタイム 0.25 秒で測定
- ▼ 測定範囲：1nm ~ 1μm

仕様

視野	最大 10 φ	
水平方向分解能	20μm/画素（視野 10 φ のとき）	
高さ計測精度	相対モード	± 1nm（視野 10 φ のとき）
	直接モード	± 15nm（視野 10 φ のとき）
高さ計測時間	0.25 秒	
外形寸法 および重量 （突起部含まず）	光学測定部	450mm (W) × 650mm (H) × 360mm (D) 45 kg
	除振台	600mm (W) × 500mm (H) × 90mm (D) 50 kg
	処理装置本体	190mm (W) × 420mm (H) × 470mm (D) 10 kg
電源	AC 100V/230V 250VA	
使用条件	温度	10 ~ 40°C
	湿度	85% 以下（結露なきこと）



YM ワイエムシステムズ株式会社

〒600-8815
 京都府京都市下京区中堂寺栗田町 93 番地
 京都リサーチパーク SCB 3 号館
 TEL: 075-315-0771 E-Mail: info@ym-systems.co.jp
 FAX: 075-315-1770 URL http://www.ym-systems.co.jp